

1. 仕 様

〇測定範囲	X軸 600mm(445 mm) * 指	舌弧内はレーザー使用時
	Y軸 600mm(547 mm)	
	Z軸 150 mm		
〇最小表示量	0.1 μ m		
〇測長ユニット	反射型リニアエ	ンコーダ	
〇画像検出方式	高感度CCDカメ	5 (B&W)	
〇照明装置	垂直落射		
	透過		
	プログラム制御	リング照明	
〇観察装置	プログラム制御	パワーターレット	
〇測定精度	X・Y軸 (1.5	$+3L/1000)$ μ m	
	Z軸 (3+4L/100	0)µm Z軸(レーザ	$-$) (2.5+4L/1000) μ m
〇最大測定物重量	40kg		
〇レンズ・光学系	1x (分解能)	0.4µm (最大社	見野) 6.4x4.7mm
	2. 5x	0.18 <i>µ</i> m	2.1x1.9mm
	5x	0.07 μ m	1.1x0.95mm

2. 基本操作方法 QVPAK





図3 移動操作ウィンドウ

- 〇各部の説明
 - a ツールバー コマンドの選択や装置の設定を行う.
 - b 画像表示ウィンドウ CCDカメラで観察中の画像を表示する.
 - c 測定結果ウィンドウ コマンドを実行した結果(測定結果)を表示する. d 座標表示ウィンドウ
 - 「座標表示ワイントワ 現在位置を表示する.機械座標系(MCS),測定物 座標系(PCS)で表示される.

e 照明操作ウィンドウ(図2)

透過照明、落射照明など照明を設定する.

f 移動操作ウィンドウ(図3)

ステージXY方向の移動、カメラのZ方向移動を操作する.

- g コマンドアイコン アイコン化したコマンドの表示.
- h 現在のステータス表示部

左から,現在の操作状況(マニュアル測定,記録モード,オート), 単位系(mm,μm),座標系(MCS,PCS),現在のカメラの倍率を表示. 〇ステージ・カメラの移動

移動操作ウィンドウのほかに、ジョイスティックで操作可能(J/S使用にチェックがはいっていること). X・Y方向にはスティックを傾けた方向にカメラが移動する形になる、カメラの上下方向(フォーカス)の 移動はスティック上部のつまみを回転させる.

〇測定方法の基礎(手順)

- 1 測定物をステージに乗せる
- 2 見たいところに移動する
 ジョイスティックもしくは移動ウィンドウで測定物を移動させる
- 3 照明を調節する
 - 照明操作ウィンドウで照明を調節する
 - 注)透過照明の場合照明が強すぎると、光の回り込みが起こり端面がぼやけることがある ので、適切な強さに照明を調節すること。
- 4 レンズの倍率を変更する(場合によってはレンズを交換する)
- 5 座標を設定する
 - 品物に合った方法で座標を設定する.※ 3.座標設定方法参照
- 6 各部の測定・演算を行う

基本的にはコマンドアイコン部でほとんどの操作が可能。ツールバーから選んでも可能。

③ 測定方法の例

~ QVPAK Training Template の測定 ~

図4の練習用テンプレートを利用して,操作方法について 説明していきます.



図4 練習用テンプレート



図5 コマンドアイコンの説明

〇テンプレートのOHPをステージに載せる
 〇照明を透過で10程度に調節する
 〇フォーカスをあわせる
 まずは、手動で調節



〇座標系の設定

・端面①を測定する
 ジョイスティックで試料を移動させ、画像
 表示ウィンドウに端面①が映るようにする.

▲ 線測定を選択.

と、図6が表示される.

____を選択.

画像表示ウィンドウの端面①の白黒境界付 近を1点クリック.赤色矢印が出て境界に 緑の点が表示される.されない場合は,照 明・フォーカスを調節し,再度行うこと. ステージを動かして,端面①のもう1点をク リック. (2点間の間隔はできるだけ広くと ること.)





・端面①をX軸に設定
 X軸設定をクリックし、端面①
 を選択して



図6 測定条件ウィンドウ



図7 結果出力ウィンドウ

非接触三次元測定機をマスターしよう!! p.6







〇円⑦と円⑩~⑯の距離を測定する. さらに、円⑪の隣り合う円同士の角度 を求める

・ 円(1)を測定する

 ・ 円測定をクリック.
 ・ 同じように円(3)~(1)をクリック
 ・ 同じように円(3)~(1)をクリック
 ・ 同じとの(2)との距離の測定
 ・ 一 距離をクリック.
 要素1に円(2)を選択し、LCにチェックが入れて
 ・ 同じように円(3)~(1)について距離を求める
 ・ 同じょうに円(3)~(1)について距離を求める
 ・ 円(2)~(1)の隣り合う円の角度を求める
 ・ 一 角度をクリック.
 要素1に円(2)を選択
 要素2に円(3)をクリックし、投影角度にチェックを入れて
 ・ 同じょうに隣り合う円同士の角度を求める

以上で、テンプレートを使った測定例を終わります



4. プログラムをつくる

同じ測定物が多数ある場合に便利な機能.記録モードでの測定手順はすべて 記憶される.したがって一つ目の測定物を一通り測定したら,その後は自動で 測定可能.

〇記録モード

ツールバー → プログラム → 記録

をクリックすると、図15がでてくる. その後の測定はすべて記憶される. 記録モードを終了したら、ツールバー → プログラム → 実行を押す. 保存場所を聞いてくるので、名前を入れて保存する.



図15 記録モードに入ったときに表示されるウィンドウ

〇測定物仮座標系の設定方法

自動測定の場合,測定物にあった仮座標系をつくらなければうまく 動作しない.

- ①記録モードに入り、プログラム中で マニュアルツールを使用し、仮の原点とX軸を設定し、その後、実際の座標系を自動で設定する.
- ②プログラムを実行する前に、マニュアルモードで座標系を設定しておく、その場合、プログラムを作成するときに、"MCSへの復帰"のチェックをはずしておくこと。

Oステップ&リピート

たとえば、ある品物で等間隔に開いた穴の計測をする場合などに 便利な機能.縦方向に3mmピッチ、横方向に5mmピッチずつ移動して、 測定できる

例 縦方向2mmピッチ,横方向5mmピッチで20 x 50mmの面積のZ方向の高
 さを測定する場合

ツールバー → プログラム → 記録を選択し を押す ツールバー → プログラム → ステップ&リピート → 直交座標系 を選択. 繰返し数: 10 図16のように設定して を押す XD ツールバー → プログラム → ステッ YD プ&リピート → 直交座標系 を選択. ZD ラベル名: tate 図17のように設定して \min を押す ◆ ル-プ内で PCS 設定を行わない ル-プ内で PCS 設定を行う 点測定 🔀 オートフォーカス **X**取消 了解 を選択し、画像の中心を一点クリック 図16 設定方法 を押す 交座標 ステップ&リピート X. Y. Zにチェックが入っていることを 繰返し数: 10 XD 確認して を押す YD ツールバー → プログラム → ステッ ZD プ&リピート終了 を選択して ラベル名: yoko ◆ ルーフア)で FCS 設定を行わない ループ内で FCS 設定を行う を押す ツールバー → プログラム → ステッ **X**取消 了解 プ&リピート終了 を選択して 図17 設定方法 を押す. ツールバー → プログラム → 実行 を選択し, ファイル名を入力し

てファイル保存すると、即実行される.

実行されると、まず横方向に5mmピッチで移動しながら、オートフォーカスで高さを測定する.10回繰り返したら縦方向に2mm移動し、また横方向に測定する.

非接触三次元測定機をマスターしよう!!

p.10



この装置には、レーザープローブが付属している.Z方向の高さを精 度よく測定したい場合、レーザープローブを使用するとよい.

例 ある面をレーザープローブで走査して、面形状を測定する

ジョイスティック等で測定面にフォーカスをあわせる. 測定開始点に移動する. ツールバー → 計測 → ポイントバッファ を選択すると図18 がでてくる.

ウィンドウ中の"レーザー"をクリック.

測定ヘッドが動き、レーザープローブに切り替わる.



図19のように設定する。各パラメータの説明は図参照。

^{実行リール}実行ツールを押すと測定を開始する.

測定終了後, 出力(E)... 出力を選択し, Mshapeのファイル形式を 選択して, 保存する.

※解析する場合は、Mshape(別ソフトウェア)を使用する.



出力コメント:	
- ◇ COM1 へ出力 ◇ COM2 へ出力 ([出力タイプ: MShape
↔ ファイルへ出力 出力ファイル名:	参照 ファイル
✔7解	X 取消



図19 レーザーでの測定条件設定



図21 Mshapeでの解析例(研磨後のダイヤモンド表面)